Снижение порога генерации с помощью легирования в лазерах среднего инфракрасного диапазона на основе HgCdTe с квантовыми ямами HgTe

© А.А. Дубинов, В.Я. Алешкин, С.В. Морозов

Институт физики микроструктур Российской академии наук, 603950 Нижний Новгород, Россия Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 603950 Нижний Новгород, Россия E-mail: sanya@ipm.sci-nnov.ru

(Получена 30 января 2018 г. Принята к печати 20 февраля 2018 г.)

Предложена и проанализирована возможность значительного снижения порога межзонной генерации в лазерных структурах среднего инфракрасного диапазона на основе HgCdTe с квантовыми ямами HgTe с помощью легирования донорами путем введения δ -слоев, расположенных вблизи квантовых ям. Показано, что при оптимальной поверхностной концентрации доноров в δ -слое 4 $\cdot 10^{10}$ см⁻² и рабочей температуре > 40 K возможно снижение порога лазерной генерации на длине волны 20 мкм более чем в 2 раза.

DOI: 10.21883/FTP.2018.09.46159.8833

1. Введение

В настоящее время для различных применений востребованы полупроводниковые лазеры, излучающие в среднем и дальнем инфракрасном (ИК) диапазоне длин волн. На сегодняшний день наиболее продвинутыми в этом диапазоне частот являются квантовые каскадные лазеры (ККЛ) на основе GaAs и InP [1]. Однако чрезвычайно сложная зонная схема каскадных структур, высокие требования по контролю параметров затрудняют их воспроизводимость. Кроме того, длина волны излучения в ККЛ сложно поддается перестройке.

Альтернативу ККЛ могут составить межзонные лазеры на основе полупроводников с узкой запрещенной зоной. Тройные полупроводниковые соединения, содержащие тяжелые элементы, в частности HgCdTe, имеют ширину прямой запрещенной зоны, покрывающую широкий спектральный диапазон 0-1.6 эВ. Это дает возможность для наблюдения стимулированного излучения среднего ИК диапазона на межзонных оптических переходах при неравновесной накачке в таких полупроводниках. Недавние исследования оптических свойств волноводных структур HgCdTe с квантовыми ямами (КЯ) НgTe, которые выращиваются при низких температурах методом молекулярно-лучевой эпитаксии [2-4], выявили значительное повышение качества таких структур по сравнению с предшествующими, что позволило обнаружить стимулированное излучение (СИ) в среднем ИК диапазоне длин волн (вплоть до $\lambda \approx 20$ мкм) [5–9]. Однако пороговая интенсивность накачки для возбуждения наиболее длинноволнового СИ была довольно велика, что сказалось и на максимальной температуре (T* = 45 K), при которой наблюдалось СИ. Одной из причин этого является существенная оже-рекомбинация в узкозонных КЯ HgTe.

В настоящей работе мы предлагаем и анализируем возможность значительного снижения порога генера-

ции за счет выключения одной из возможных схем оже-рекомбинации с помощью легирования донорами за счет δ -слоев, расположенных вблизи КЯ.

2. Модель

Оценку для пороговой плотности тока в лазере на основе HgCdTe с квантовыми ямами HgTe, используя подход, развитый в работе [10] для лазера с объемной активной областью, можно получить из следующего выражения:

$$j_{\rm th} = qD(C_n \hat{n}^2 \hat{p} + C_p \hat{p}^2 \hat{n} + R_d + B \hat{n} \hat{p}), \qquad (1)$$

где q — заряд электрона, D — толщина волновода, C_n и C_p — коэффициенты оже-рекомбинации, $R_d = (\hat{n} + \hat{p})/\tau$ и τ — скорость и время безызлучательной рекомбинации Шокли-Рида-Холла, B — коэффициент излучательной рекомбинации, \hat{n} и \hat{p} — пороговые неравновесные объемные концентрации электронов и дырок соответственно. Для того чтобы перейти к случаю лазера с квантовыми ямами (двумерный случай) в качестве активной области, необходимо ввести поверхностные концентрации электронов и дырок, соответственно $n = Qd\hat{n}$ и $p = Qd\hat{p}$, где Q и d — число квантовых ям и их толщина. Для аналогичного лазера с оптической накачкой непосредственно в КЯ можно ввести связь между пороговой интенсивностью излучения оптической накачки (I_{th}) и пороговой плотностью тока (j_{th}) [11]:

$$I_{\rm th} = \frac{W}{\eta q} j_{\rm th},\tag{2}$$

где W — энергия кванта излучения оптической накачки, η — доля излучения оптической накачки, поглощенная в КЯ.

Для нахождения пороговых значений концентраций электронов и дырок можно использовать выражение для порога генерации лазера: $g(n, p) = \alpha$, где g(n, p) — модовый коэффициент усиления активной среды с учетом внутренних потерь, а α — коэффициент потерь на выход излучения из лазера. Коэффициент g(n, p) в случае, когда генерация излучения происходит на длине волны, соответствующей ширине запрещенной зоны E_g , определяется следующей формулой:

$$g(n, p) = A(f_n - f_p), \qquad (3)$$

где $A = 40 \text{ см}^{-1}$ (расчетное значение, полученное в работе [12] для лазерной структуры, аналогичной структуре, в которой наблюдалось стимулированное излучение с $\lambda \approx 20 \text{ мкм}$ [8]),

$$f_n = \frac{1}{1 + \exp\{(E_g - E_F^n)/k_BT\}},$$
$$f_p = \frac{1}{1 + \exp\{-E_F^p/k_BT\}}$$

— функции распределения электронов и дырок для $\lambda = 2\pi \hbar c/E_g$, c — скорость света в вакууме, T — температура, $k_{\rm B}$ и \hbar — постоянные Больцмана и Планка соответственно. Неравновесные квазиуровни Ферми для электронов ($E_{\rm F}^n$) и дырок ($E_{\rm F}^p$) в зависимости от концентраций полностью ионизованной донорной примеси (N) в δ -слоях и инжектируемых носителей (n и p) можно найти из следующих выражений в приближении чисто двумерного случая и параболических зон:

$$E_{\rm F}^n = E_g + k_{\rm B}T \ln\left[\exp\left\{\frac{\pi\hbar^2(n+N)}{k_{\rm B}Tm_n}\right\} - 1\right],\qquad(4)$$

$$E_{\rm F}^p = -k_{\rm B}T \ln\left[\exp\left\{\frac{\pi\hbar^2 p}{k_{\rm B}Tm_p}\right\} - 1\right],\qquad(5)$$

где m_n и m_p — массы плотности состояний электронов и дырок соответственно. Для достаточно узкозонных КЯ НgTe можно считать, что массы электронов и дырок в основных состояниях одинаковы: $m = m_n \approx m_p$ [8,12]. В приближении n = p, учитывая формулы (3)–(5), можно записать для пороговой концентрации неравновесных носителей следующее выражение ($A > \alpha$):

$$n = \frac{1}{P} \ln\left[\frac{1 + \exp(-PN)}{1 - \alpha/A}\right],\tag{6}$$

где $P = \pi \hbar^2 / m k_B T$. Подставляя выражение (6) в формулы (1) и (2), можно найти соответственно значения пороговых плотности тока и интенсивности накачки в лазере.

Основным процессом в условиях интенсивной накачки при межзонной рекомбинации электрона и дырки в узкозонных полупроводниках является безызлучательная оже-рекомбинация. Известно, что причина увеличения скорости оже-рекомбинации лежит в увеличении разницы между эффективными массами электронов и дырок. Чем больше такая разница, тем ниже энергетический порог оже-рекомбинации. В конечном счете при очень

Физика и техника полупроводников, 2018, том 52, вып. 9

большой разнице масс электронов и дырок результатом является практически беспороговый оже-процесс, когда при любой концентрации неравновесных носителей межзонная рекомбинация беспороговым образом происходит через безызлучательную оже-рекомбинацию. Обратно, в структурах с симметричным законом дисперсии порог оже-рекомбинации максимальный. Таким образом, даже в материале с очень малой щелью определенная симметрия законов дисперсии носителей позволяет подавить оже-рекомбинацию, которая является одним из важнейших факторов, ограничивающих возможность получения инверсии населенностей. Так, при симметричном дираковском законе дисперсии (с ненулевой массой носителей) оже-рекомбинация полностью запрещена в силу невозможности выполнения законов сохранения энергии и импульса при оже-процессе. В КЯ HgTe/HgCdTe можно обеспечить аналогичную симметрию, причем подбор ширины КЯ позволяет добиться конечной энергетической щели, но в то же время сохранить симметричный закон дисперсии. Узкозонные КЯ НgTe обладают квази-дираковским, т.е. гиперболическим и симметричным, законом дисперсии для основных состояний электронов и дырок, по крайней мере в окрестности k = 0. Как было показано в [8,9], это может существенно подавить оже-рекомбинацию между этими состояниями. Однако при продвижении генерации СИ в более длинные волны необходимо большее усиление для преодоления потерь Друде, которые увеличиваются квадратично с длиной волны. Это приводит к увеличению необходимой концентрации носителей и изменению функции распределения их в подзонах размерного квантования.

Если разность в энергиях первой и второй подзон электронов может в несколько раз превышать разность в энергиях первых подзон электронов и дырок (шири-

Рис. 1. Электронный спектр КЯ HgTe толщиной 4.6 нм, заключенной в барьеры Hg_{0.3}Cd_{0.7}Te (013), при T = 20 K. Волновой вектор направлен по направлению [100]. E_1 и E_2 — 1-я и 2-я электронные подзоны соответственно; H_1 и H_2 — 1-я и 2-я дырочные подзоны соответственно.



на запрещенной зоны в КЯ), то разность в энергиях первой и второй подзон дырок сопоставима с шириной запрещенной зоны. Кроме того, при больших значениях квазиимпульса закон дисперсии дырок перестает быть квази-дираковским. Это иллюстрирует рис. 1, на котором представлен электронный спектр КЯ HgTe толщиной 4.6 нм, заключенной в барьеры Hg_{0.3}Cd_{0.7}Te (013), при T = 20 К. Волновой вектор на рисунке направлен по [100]. Для расчета электронного спектра использовалась модель Кейна 8 × 8 [13].

Все это приводит к тому, что оже-процесс с участием 2 дырок и электрона становится намного более вероятным, чем оже-процесс с участием 2 электронов и дырки, т.е. $C_n \ll C_p$. Для дальнейших расчетов будет использовано приближение $C_n = 0$. Отсюда следует, что для уменьшения порога генерации СИ необходимо уменьшать концентрацию неравновесных дырок. Условие инверсии населенности — разность квазиэнергий Ферми неравновесных электронов и дырок должна превышать ширину запрещенной зоны — можно обеспечить с помощью легирования донорами путем введения δ-слоев, расположенных вблизи КЯ. При этом увеличение поглощения Друде будет минимальным, а уровень Ферми окажется в зоне проводимости КЯ HgTe, и для выполнения условия инверсии населенности достаточно будет значительно меньшей концентрации неравновесных инжектируемых электронов и дырок.

3. Результаты расчета

На рис. 2 приведена зависимость пороговых плотности тока и соответствующей ей согласно формуле (2) интенсивности накачки с энергией фотона 0.54 эВ ($\lambda = 2.3$ мкм), $\eta \approx 0.01$ [11] от концентрации легирующей примеси в лазере на основе Hg_{0.3}Cd_{0.7}Te с квантовыми ямами HgTe толщиной d = 4.6 нм, Q = 5,



Рис. 2. Зависимости пороговых плотности тока (j_{th}) и интенсивности накачки (I_{th}) с $\lambda = 2.3$ мкм от концентрации легирующей примеси в лазере на основе Hg_{0.3}Cd_{0.7}Te с квантовыми ямами HgTe толщиной d = 4.6 нм, Q = 5, для трех значений температуры T, K: I - 20, 2 - 30, 3 - 40.



Рис. 3. Зависимости пороговой концентрации инжектированных электронов от концентрации легирующей примеси в лазере на основе Hg_{0.3}Cd_{0.7}Te с квантовыми ямами HgTe толщиной d = 4.6 нм, Q = 5, для трех значений температуры T, K: 1 - 20, 2 - 30, 3 - 40.



Рис. 4. Зависимости N_{opt} (сплошная кривая) и отношения плотностей порогового тока для $N = N_{opt}$ и N = 0 (штриховая кривая) от температуры.

для трех значений температуры. Так как в литературе практически отсутствуют значения параметров для оже- и излучательной рекомбинации в узкозонных КЯ HgTe, для оценки были использованы параметры для объемных растворов HgCdTe с той же шириной запрещенной зоны: $C_p = 1.25 \cdot 10^{-24} \, {\rm cm}^6/{\rm c}$ и $B = 1.5 \cdot 10^{-10} \, {\rm cm}^3/{\rm c}$ [14]. Время безызлучательной рекомбинации Шокли–Рида–Холла для узкозонных КЯ HgTe было определено из экспериментальных данных [15]: $\tau = 1 \, {\rm mkc}$, а масса $m = 0.016m_0 \, (m_0$ — масса свободного электрона) определена из аппроксимации электронного спектра на рис. 1. Характерный коэффициент потерь на выход излучения из лазера длиной 1 мм: $\alpha = 10 \, {\rm cm}^{-1}$ при $\lambda \approx 20 \, {\rm mkm}$ для $T = 20 \, {\rm K}$, $D = 5 \, {\rm mkm}$.

Как видно из рисунка, для всех температур существует оптимальное значение концентрации полностью

ионизованной донорной примеси $N = N_{opt}$ в δ -слоях, при котором пороговые плотность тока и интенсивность накачки минимальны. Из рис. З видно существенное (в ~ 3 раза) снижение пороговых концентраций инжектируемых носителей с ростом *N*. При этом значение N_{opt} практически линейно растет от 10⁹ до концентрации $4 \cdot 10^{10}$ см⁻² с ростом температуры от 4 до 50 K, и происходит снижение порога генерации СИ более чем в 2 раза (см. рис. 4). Следовательно, можно сделать вывод, что создание в лазерных HgCdTe-структурах с КЯ HgTe, легированных донорной примесью δ -слоев с оптимальной концентрацией, наиболее выгодно для снижения порога генерации при высоких рабочих температурах.

4. Заключение

Проведенные оценки для лазерной HgCdTe-структуры с КЯ HgTe, аналогичной структуре из работы [8], излучающей на $\lambda \approx 20$ мкм, показали, что при добавлении в структуру δ -слоев с поверхностной концентрацией доноров $4 \cdot 10^{10}$ см⁻² возможно снижение порога генерации СИ более чем в 2 раза, а следовательно, возможно увеличение максимальной температуры, при которой наблюдается СИ.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 17-12-01360).

Список литературы

- M.S. Vitiello, G. Scalari, B. Williams, P. De Natale. Opt. Express, 23 (4), 5167 (2015).
- [2] V.S. Varavin, V.V. Vasiliev, S.A. Dvoretsky, N.N. Mikhailov, V.N. Ovsyuk, Y.G. Sidorov, A.O. Suslyakov, M.V. Yakushev, A.L. Aseev. Proc. SPIE, **5136**, 381 (2003).
- S. Dvoretsky, N. Mikhailov, Yu. Sidorov, V. Shvets, S. Danilov,
 B. Wittman, S. Ganichev. J. Electron. Mater., 39 (7), 918 (2010).
- [4] N.N. Mikhailov, R.N. Smirnov, S.A. Dvoretsky, Yu.G. Sidorov, V.A. Shvets, E.V. Spesivtsev, S.V. Rykhlitski. Int. J. Nanotechnol., 3 (1), 120 (2006).
- [5] S.V. Morozov, V.V. Rumyantsev, A.A. Dubinov, A.V. Antonov, A.M. Kadykov, K.E. Kudryavtsev, D.I. Kuritsin, N.N. Mikhailov, S.A. Dvoretskii, V.I. Gavrilenko. Appl. Phys. Lett., 107, 042105 (2015).
- [6] S.V. Morozov, V.V. Rumyantsev, A.M. Kadykov, A.A. Dubinov, K.E. Kudryavtsev, A.V. Antonov, N.N. Mikhailov, S.A. Dvoretskii, V.I. Gavrilenko. Appl. Phys. Lett., 108, 092104 (2016).
- [7] В.В. Румянцев, М.А. Фадеев, С.В. Морозов, А.А. Дубинов, К.Е. Кудрявцев, А.М. Кадыков, И.В. Тузов, С.А. Дворецкий, Н.Н. Михайлов, В.И. Гавриленко, F. Терре. ФТП, 50 (12), 1679 (2016).
- [8] S.V. Morozov, V.V. Rumyantsev, M.A. Fadeev, M.S. Zholudev, K.E. Kudryavtsev, A.V. Antonov, A.M. Kadykov, A.A. Dubinov, N.N. Mikhailov, S.A. Dvoretsky, V.I. Gavrilenko. Appl. Phys. Lett., **111**, 192101 (2017).

- [9] В.В. Румянцев, А.М. Кадыков, М.А. Фадеев, А.А. Дубинов, В.В. Уточкин, Н.Н. Михайлов, С.А. Дворецкий, С.В. Морозов, В.И. Гавриленко. ФТП, **51** (12), 1616 (2017).
- [10] А.А. Дубинов. ФТП, **50** (11), 1469 (2016).
- [11] С.В. Морозов, М.С. Жолудев, А.В. Антонов, В.В. Румянцев, В.И. Гавриленко, В.Я. Алешкин, А.А. Дубинов, Н.Н. Михайлов, С.А. Дворецкий, О. Drachenko, S. Winnerl, H. Schneider, M. Helm. ФТП, **46** (11), 1388 (2012).
- [12] A.A. Dubinov, V.Ya. Aleshkin. Int. J. High Speed Electron. Syst., 25, 1640018 (2016).
- [13] M. Zholudev, F. Teppe, M. Orlita, C. Consejo, J. Torres, N. Dyakonova, M. Czapkiewicz, J. Wrobel, G. Grabecki, N. Mikhailov, S. Dvoretskii, A. Ikonnikov, K. Spirin, V. Aleshkin, V. Gavrilenko, W. Knap. Phys. Rev. B, 86 (20), 205420 (2012).
- [14] E. Bellotti, D. D'Orsogna. IEEE J. Quant. Electron., 42 (4), 418 (2006).
- [15] В.В. Румянцев, А.В. Иконников, А.В. Антонов, С.В. Морозов, М.С. Жолудев, К.Е. Спирин, В.И. Гавриленко, С.А. Дворецкий, Н.Н. Михайлов. ФТП, 47 (11), 1446 (2013).

Редактор Л.В. Шаронова

Reduction of the generation threshold by doping in mid-infrared lasers based on HgCdTe with HgTe quantum wells

A.A. Dubinov, V.Ya. Aleshkin, S.V. Morozov

Institute for Physics of Microstuctures, Russian Academy of Sciences, 603950 Nizhny Novgorod, Russia Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, 603950 Nizhny Novgorod, Russia

Abstract The possibility of a significant reduction in the interband generation threshold in mid-IR laser structures based on HgCdTe with HgTe quantum wells is proposed and analyzed. To obtain the result the structures are doped by using δ -layers located near the quantum wells. It is shown that at an optimum surface donor concentration in δ -layers $4 \cdot 10^{10}$ cm⁻² and an operating temperature > 40 K, the laser generation threshold at the wavelength of 20 μ m can be reduced by more than 2 times.